

(改正案)

注意：今回の改正は別表3のみが該当するため、別表3のみを意見募集の対象とします。

計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程

別表第 3 (第 18 条関係) 計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器又は標準物質の校正等の期間

区分の名称	計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質	期間
長さ	校正用ブロックゲージ、目盛りの長さが 50 mm 以上 1 000 mm 以下の標準尺であって拡張不確かさ ($k=2$) が 1 000 mm 相当で $2 \mu\text{m}$ を超えないもの、各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの、リングゲージ及びプラグゲージ、 <u>座標測定機用ゲージ</u>	2 年
	633 nm よう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、532 nm よう素分子吸収線波長安定化レーザ装置、1.5 μm 帯 (C バンド) アセチレン分子吸収線波長安定化レーザ装置、1.5 μm 帯 (C バンド) シアン化水素分子吸収線波長安定化レーザ装置、干渉計基準用ブロックゲージ、標準尺であって前記以外のもの、平面度校正装置、平面度基準板及び校正用表面性状標準片	3 年
質量	質量校正用の分銅及びおもり	3 年
温度	温度計校正用の水の三重点実現装置並びに放射温度計校正用の亜鉛点実現装置、アルミニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現装置及び単色放射温度計	2 年
光	光度標準電球、全光束標準電球、単平面型照度標準電球、分光放射照度標準電球 (ハロゲン電球)、分布温度標準電球及び分光応答度標準器	3 年
	分光放射照度標準電球 (重水素ランプ)	2 年
角度	ロータリエンコーダ及びロータリエンコーダ校正装置	2 年
体積	体積校正用分銅	3 年
	密度浮ひょう	5 年
流量・流速	<u>水用流量計液体流量校正装置</u> 校正用の分銅、おもり及び質量計	3 年
	ISO 型トロイダルスロート音速ノズル <u>並びに水用流量計校正用の周波数標準器、周波数発生器及び周波数測定器</u>	5 年
振動加速度	振動加速度計 (圧電型 (20 Hz 以上))	2 年
	レーザ干渉式振動測定装置	3 年
	振動加速度計 (サーボ型)	4 年
電気 (直流・低周波)	計器用変圧器、変成比分圧器、変流器及び電流比較器	3 年
電気 (高周波)	電界用ダイポールアンテナ	2 年

密度・屈折率	シリコン単結晶、浮ひょう及び固体密度標準	5 年
力	力計（ロードセル、環状ばね型力計、容積型力計及びその他の弾性体による力計）	26 ヶ月
	一軸試験機又は簡易型力計校正用の分銅及びおもり	5 年
圧力	重錘形圧力天びん及び液柱形圧力計	3 年
音響・超音波	計測用マイクロホン、サウンドレベルメータ及び音響校正器	2 年
放射線・放射能・中性子	軟 X 線用線量計、中硬 X 線用線量計、 γ 線用線量計、線量計校正用 γ 線源、線量計校正用 γ 線照射装置、 β 線用線量計、 β 線照射装置、液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、井戸型放射能測定装置、 γ 線スペクトロメータ及び減速材付中性子検出器	2 年
硬さ	ロックウェル硬さ試験機、ロックウェル硬さ標準片、ビッカース硬さ試験機及びビッカース硬さ標準片	5 年

計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程 第 8 版 改正のポイント

1. 主な改正内容

- (1) 別表第 3 中、「長さ」の「計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質」に「座標測定機用ゲージ」を追加する。
- (2) 別表第 3 中、「流量・流速」の「計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質」の「液体流量校正装置校正用の分銅、おもり及び質量計」を「水用流量計校正用の分銅、おもり及び質量計」に名称を変更する。
- (3) 別表第 3 中、「流量・流速」の「計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質」に「水用流量計校正用の周波数標準器、周波数発生器及び周波数測定器」を追加する。

2. 改正理由

長さにおいては JCSS の登録対象を拡大するため、流量・流速においては実態にあわせた名称への変更及び常用参照標準として周波数標準器等を追加するため。

改正箇所には下線を付してあります。